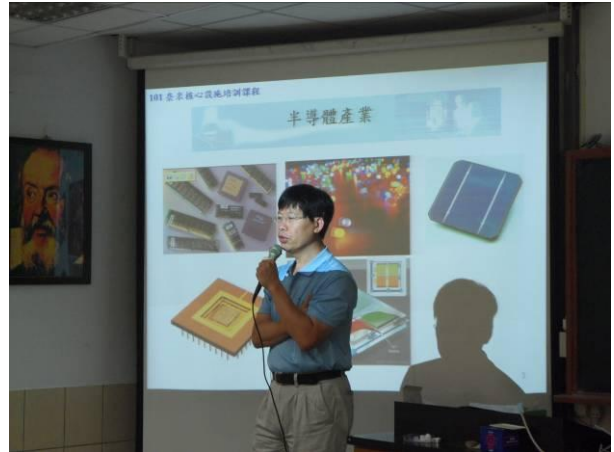


國立彰化師範大學科技研究總中心所屬共同儀器中心

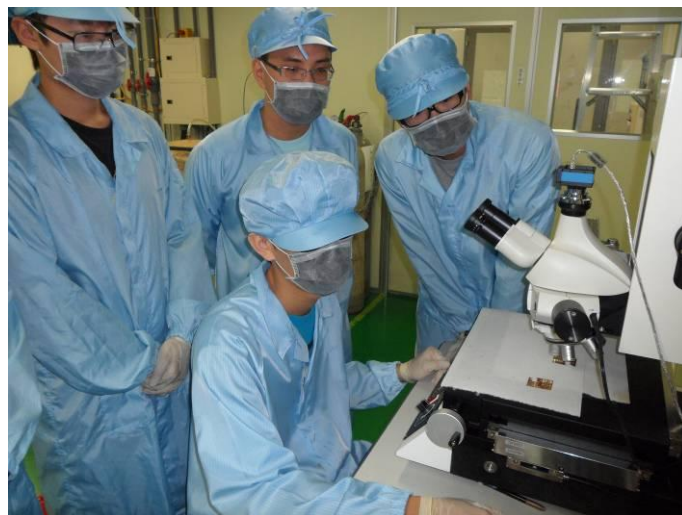
儀器使用人員教育訓練與資格檢定 成果報告表

課程名稱	奈米核心設施培訓研習會-光微影系統曝光機(Mask Aligner)			
儀器名稱 (中英文名稱)	光微影系統曝光機(Mask Aligner)			
課程時間	102年9月3日			
主辦單位/中心	奈米科技中心			
報名人數	原理講解：32人 上機操作：5人			
檢定項目	上機實驗操作，15分鐘完成所有程序，85分以上始達發證標準			
通過人員名單	系所單位	姓名		
	物理學系	劉○鵬 陳○麟		
	機電工程學系	盧○亨 江○清 吳○豐		
發證率	100%			
費用收入	7,500元(1,500元*5人)			
費用支出	講師費：5600元 餐費：960元 印刷費：505元	總計	7,065元	
課程表				
	講題	日期	地點	主講人
	半導體製程與 曝光系統簡介	9/3(二) 9:00~12:00	格致館 811教室	國立彰化師範大學 機電系 沈志雄教授
	曝光機操作訓練	9/3(二) 13:00~17:00	藝薈館 B1 奈米科技中心	
訓練/課程照片				

原理與系統簡介照片



上機操作訓練照片



1. 請於開辦教育訓練結束三周內填妥本表以便製作證書，電子檔逕寄科技研究總中心科技服務組李佳樺助理 chli@cc.ncue.edu.tw，另請將費用核銷用之紙本單據送至科總中心，俾利辦理訓練費用核銷及成果訊息刊登等事宜，校內分機1702，若有填表相關問題請與我聯繫，謝謝您的協助。
2. 本表資訊公開公告於<http://hrst2.ncue.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=41>